

參訪前計畫書

組員：4A3L0018 陳聖鎧
4A3L0058 王瑋嘉
4A3L0075 簡登偉
4A3L0099 楊邵歲

(一) 參訪動機

想知道國家奈米元件實驗室是在做什麼的-----陳聖鎧

想看看國家奈米元件實驗室的無塵室-----王瑋嘉

想看看國家奈米實驗室是如何作業的----簡登偉

參觀與認識國家奈米元件實驗室並且拓寬自己的視野-----楊邵崴

(二) 自己想要「主動學習」到些什麼?

想藉由這次機會去了解無塵室機台的操作過程，以及目的-----陳聖鎧

了解晶圓清洗、濕蝕刻製程、PECVD、感應耦合式電漿蝕刻系統和反應式離子蝕刻系統，並學習如何操作無塵室機台-----王瑋嘉

想了解無塵室的操作過程與方法----簡登偉

對於濕蝕刻&微影&爐管等有更進一步的認識,並從許多製程裡觀察儀器的操縱方式去學習 -----楊邵崴

(三) 預計在參訪時「提問」些什麼問題?

濕蝕刻與乾蝕刻的差別與應用-----陳聖鎧

PECVD、感應耦合式電漿蝕刻系統及反應式離子蝕刻系統有哪些差別?-----王瑋嘉

蝕刻的過程與各種環境產生的結果----簡登偉

反應式離子蝕刻系統 RIE CHAMBER 適合在何種情況使用?----楊邵巖